



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

**DIREZIONE GENERALE**

Il Direttore Generale

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;

**Visto** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e successive modificazioni;

**Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) ed in particolare l'art. 1 comma 510;

**Visto** l'art. 59 punto 2 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Politecnico di Milano vigente, sulle funzioni dei dirigenti in merito all'autorizzazione a contrarre;

**Visto** il Regolamento per l'affidamento di contratti per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia di rilevanza comunitaria o tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara del Politecnico di Milano;

**Visto** il Regolamento per gli Incentivi per Funzioni Tecniche del Politecnico di Milano;

**Vista** la convenzione tra Politecnico di Milano e STMicroelectronics S.r.l. denominata JRC STEAM;

**Considerato** che nell'ambito delle attività di ricerca previste all'interno della convenzione JRC STEAM si rende necessaria l'acquisizione di un sistema dedicato per litografia elettronica (electron beam lithography o in breve EBL) che utilizzi elettroni per la scrittura dei design creati dagli utenti, da installarsi presso il centro PoliFAB del Politecnico di Milano;

**Considerato** che tale macchinario è indispensabile per tutti i progetti di ricerca e sviluppo che contemplino la realizzazione di strutture sub micrometriche ad elevata risoluzione;



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

**Considerato** che l'importo massimo previsto per l'affidamento ammonta a 1.200.000,00 oltre IVA;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano n. 202212200054 del 20/12/2023 avente per oggetto "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (ex art. 1 comma 505 della Legge stabilità 2016)" per il biennio 2023-2024, che prevede la necessità di acquistare un "apparecchiatura per nanolitografia" - CUI F80057930150202200003;

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano n. 202309260428 del 26/09/2023 che ha approvato l'atto di indirizzo per l'espletamento della procedura di gara aperta europea per l'affidamento della fornitura di un'apparecchiatura per nanolitografia dando mandato all'Area Gestione Infrastrutture e Servizi (AGIS) e al PoliFAB di perfezionare gli atti di gara e bandire la relativa procedura; ha autorizzato l'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 in relazione alla procedura CUI F80057930150202200003 incrementando l'importo per un valore pari a € 1.464.000,00 IVA inclusa e autorizzato la nomina a RUP del dott. Claudio Somaschini;

**Considerato** che la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti in quanto si compone di un'unica categoria merceologica;

**Considerato** che non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi da interferenza trattandosi di mera fornitura;

**Visto** che per il bene oggetto dell'affidamento non è disponibile alcuna convenzione/accordo quadro CONSIP attiva o in attesa d'attivazione;

**Considerato** che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Considerato** che tale fornitura richieda l'avvio di una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 36/2023;

**Considerato** che gli operatori economici partecipanti, come previsto dall'art. 100 co. 1 d.lgs. 36/2023, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione a pena di esclusione:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) Installazione nel periodo 2020 - 2022 almeno 10 sistemi di litografia elettronica di prestazioni analoghe o superiori a quello oggetto del presente bando;

**Considerato** che il requisito di capacità tecnico professionale di cui alla lettera b) viene richiesto a dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti e si rende necessario al fine



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

di garantire l'effettiva capacità dei concorrenti di fornire ed installare strumentazione scientifica adeguata al livello di complessità tecnica prevista dall'oggetto della procedura;

Considerato che la procedura sarà interamente gestita in ogni sua fase fino all'aggiudicazione con sistemi telematici secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL messa a disposizione dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa, di indire una gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023 per l'affidamento della "fornitura di un'apparecchiatura per nanolitografia", utilizzando come piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA Regione Lombardia, per un importo totale posto a base d'asta di € 1.200.000,00, oltre IVA;

di imputare l'importo di € 1.200.000,00 oltre IVA, pari ad € 1.464.000,00, IVA inclusa, al codice di progetto ARES.LFAB.AUTO.LF21CONV01 - SVILUPPO POLIFAB-FONDI DA JRC STEAM con ST Microelectronics;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Claudio Somaschini.

Il Direttore Generale  
Ing. Graziano Dragoni

*Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente*